

公開番号 又は 特許番号	特開 2013-128928
発明名称	薄膜形成方法及び薄膜形成装置
出願人 又は 権利者	古河電工株式会社
想定デバイス	環境物質センシングテープ、アンビエントデバイス、エネルギーハーベスティング
要約	<p>【利用分野】 基材の走行にほとんど影響することなくダイスと基材とのクリアランスを狭め、長尺基材に対して膜厚精度の高い薄膜を連続的かつ高速に形成できるようにする。</p> <p>【発明の内容】 長尺基材を連続的に移送しながら、少なくともその一方の表面に所定の間隔をおいて対向配置されたキャビティを有する塗布ダイスを用いて基材の表面に薄膜を形成する薄膜形成方法において、塗布ダイスには、キャビティを形成する基材走行方向下流に向かって接近するテーパ部とキャビティの上流側と下流側とを連通するバイパス流路が設けられ、塗布ダイスのキャビティ内へ所定の圧力で材料溶液を供給しながら、バイパス流路に設けられた流量調節手段によりキャビティ内に発生する圧力を調整しつつ、該圧力により生じる塗布ダイスへの反発力が所定の値に保たれるように塗布ダイスに付与する基材へ向かう方向への荷重を制御して長尺基材の表面に薄膜を形成するようにした。</p>
図面	